17.- С. 445-451. 6. Колешко В.М., Самошкин М.А. Modelowanie matematyczne widzenia komputerowego przy sczytwaniu informacji graficznej I filtrowaniu sygnal video // Technologiczne systemy informacyjne w inzynierii produkcj I ksztalceniu techniczym. Lubelskie Towarzystwo Naukowe Societas ScientiarutLublinensis. — Liblin 2001. — С. 290-297.

УДК 621.88.084

В.М.Колешко, И.А.Таратын, А.В.Сергейченко

МАТРИЦА НЕСЕЛЕКТИВНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СЕНСОРОВ ЭЛЕКТРОННОГО НОСА

Белорусский национальный технический университет Минск, Беларусь

На протяжении всего времени развития металлоксидных полупроводниковых сенсоров разработчики данного направления в газовом анализе прилагали огромные усилия для создания высокоселективных детекторов газов. Однако новое течение, направленное на создание интеллектуальных устройств, способных распознавать как качественный, так и количественный состав газовых смесей, предъявляет к газовым сенсорам уже несколько иные требования. Данные устройства получили название «электронный нос» и газовые сенсоры, составляющие его основу, должны уже обладать не селективной чувствительностью к одному газу, а перекрестной чувствительностью к различным газам, запахам и парам.

Принцип работы электронного носа заключается в анализе сигналов, поступающих от линейки или матрицы неселективных газовых сенсоров при моздействии газа или смеси газов на их активные элементы.

Для проведения исследований были разработаны и изготовлены четыре типа образца с различными характеристиками активных слоев (АС). При изготовлении сенсоров использовались хорошо известные технологические методы планарной микроэлектроники. Подложка представляет собой кремниевый кристалл пассивированный с одной стороны диэлектрическими слоями Si_3N_4 и SiO_2 суммарной толщиной $\sim 1,2\,$ мкм [1, 2]. На диэлектрике сформированы тонкопленочные платиновые терморезистор и сигнальный электрод. Причем, особенность топологии состоит в том, что нагревательный элемент одновременно является и вторым сигнальным электродом. К настоящему времени исследователями изучены на предмет чувствительности к газам практически все металлоксидные полупроводники [3]. Отработаны несколько методов формирования толстых полупроводниковых

пленок — активных элементов сенсоров [3, 4]. В данной работе исследовались сенсоры на основе широкозонных полупроводников SnO₂, In₂O₃, Sb₂O₃, Co₃O₄. Для приготовления составов активных слоев использовались следующие исходные материалы: металлические Sn, In, Sb, Au, сплав ITO с содержанием компонентов In 95 масс. % и Sn 5 масс.%, ацетат кобальта. Каждый из образцов имеет особую технологию формирования активного слоя (см. Рис. 1а,б,в,г). Нанесение растворов осуществлялось при помощи микрошприца с ценой деления 0,01 микролитра. Окончательный отжиг сенсоров проводился на воздухе путем подачи напряжения на нагревательные элементы. В итоге сенсоры имеют активные слои следующих

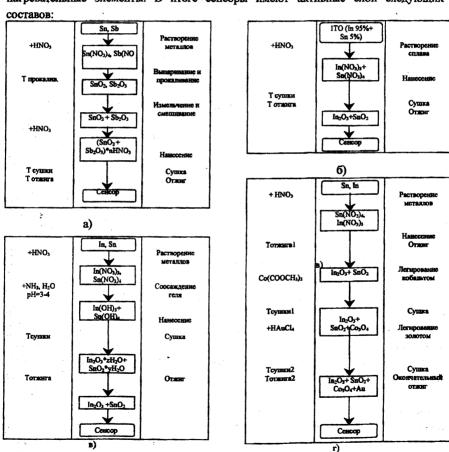


Рис. 1. Технологии формирования активных слоев неселективных сенсоров

AC образцов №1 - SnO₂+Sb₂O₃, рис. 1а;

AC образцов №2 - In₂O₃+SnO₂ (95:5), рис. 16;

AC образцов №3 - In₂O₃+SnO₂ (95:5), рис. 1в;

AC образцов №4 - In₂O₃+SnO₂+Co₃O₄+Au, рис. 1г.

Исследуемый образец помещался в измерительную ячейку. Все измерения проводились в потоке искусственного воздуха: 21% O₂ и 79% N₂. Содержание паров воды не более 0,02 г/м³. Расход газов регулировался ротаметрами, которыми оснащен генератор газовой смеси. По показаниям вольтметра снимался исходный (нулевой) сигнал. Затем в измерительную ячейку подавался исследуемый газ определенной концентрации, задаваемой системой генератора. Искусственный воздух в данном случае выполнял роль газа-разбавителя. После проведения измерений реакции сенсора на исследуемый газ, измерительная ячейка вновь продувалась искусственным воздухом до установления на выходе нулевого сигнала.

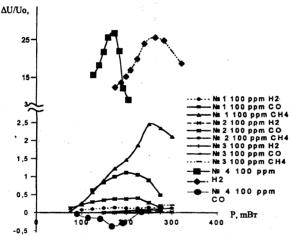


Рис. 2 Относительное изменение выходного напряжения сенсоров при воздействии H₂, CO и CH₄ для различных мощностей работы

Выходной сигнал от сенсора при наличии в атмосфере анализируемого газа — это результат установившегося адсорбционно-десорбционного процесса. Каждый газ карактеризуется энергией взаимодействия с поверхностью полупроводника и с хемосорбированным на ней кислородом. Другими словами, величина сигнала и время срабатывания сенсора существенным образом зависит от температуры и имеет, как показывают исследования, экстремальные значения. В связи е этим нами прежде всего были проведены измерения с целью обнаружения оптимальной рабочей

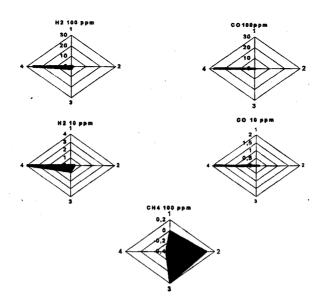


Рис. 3. Визуальные образы H₂, CO и CH₄ при различных концентрациях

температуры для каждого типа образца по отношению к каждому из исследованных газов. Концентрация газов при этом составляла 100 ppm. Результаты исследований приведены на рис. 2, где $\Delta U/U_0$ — относительное изменение выходного напряжения сенсоров при наличии исследуемого газа; U_0 — сигнал от сенсоров в воздухе. Дальнейшие измерения проводились при рабочих температурах сенсоров, соответствующих максимумам чувствительности для каждого газа.

Для того, чтобы иметь возможность определять не только состав газовой смеси, но и концентрацию входящих в нее газов необходимо знать зависимость выходных сигналов сенсоров от концентрации газов, а так же от внешних параметров, как-то атмосферного давления, относительной влажности и температуры окружающей среды. Были проведены исследования по определению зависимости выходного сигнала при изменении концентрации газов от 1 до 100 ррт (кроме метана; последний измерялся лишь при концентрации в 100 ррт). Остальные параметры оставались неизменными: температура воздуха составляла 23±2°C, а парциальное давление кислорода в воздухе и влажность определялись содержанием последних в искусственном воздухе.

На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что, используя матрицу неселективных сенсоров можно составить «портрет» любого газа. Для этой цели могут быть использованы как сенсоры с различными активными слоями, так и сенсоры, активные слои которых сформированы по различной технологии. 558

«Портреты» для H_2 и CO концентраций 100 ppм и 10 ppm, а так же для 100 ppm CH_4 представлены на рисунке 3 (цифрами на рисунке указаны номера типов сенсоров).

Работа электронного носа — это обработка (сравнение) сигналов от множества сенсоров при подаче на них неизвестного газа с данными, полученными при калибровке устройства. Если множество сигналов от четырех сенсоров еще можно обработать простыми статистическими методами, то сделать то же с большей выборкой будет гораздо сложнее. Наиболее перспективным способом, который может быть использован в газовом анализе и особенно в устройствах типа «электронный нос» для распознавания образов — «портретов» являются искусственные нейронные сети [5,6]. Хотя и здесь не обходится без сложностей. Искусственные нейронные сети требуют продолжительной и кропотливой работы по их предварительному обучению, что будет отражено в следующей статье.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сергейченко А.В., Сахарчук С.П. Планарный полупроводниковый газовый сенсор /Материалы 21-го международного научного симпозиума студентов и молодых ученых.- Зелена Гура, 2000. 2. Таратын И.А., Сергейченко А.В. Сенсор оксида углерода /12-я Научно-техническая конференция «Датчик-2000», Гурзуф. 3. Бутурлин А.И. Газочувствительные датчики на основе металлоксидных полупроводников // ЗЭТ.-1983.-№10.- С. 3. 4. Айвазов А.А. Современное состояние и перспективы развития производства толстопленочных датчиков // ЗЭТ.- 1991.- №7.- С. 36 5. Е. Llobet, J. Rubio Electronic nose simulation tool centred on Pspice /Sensors and Actuators B 3788, (2001), P. 1–11. 6. Phillip Evans, Krishna C. Persaud Evaluation of a radial basis function neural network for the determination of wheat quality from electronic nose data /Sensors and Actuators B 69, (2000), P. 348–358.

УДК 621.3.049.77

В.М. Колешко, В.В. Ковалевский

ЗАПОМИНАЮЩАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ГИГАБИТНОЙ СУПЕРПАМЯТИ

Белорусский национальный технический университет Минск, Беларусь

Необходимо отметить, что получение устройства с таким большим объемом накопителя возможно (и экономически оправдано) только за счет использования схемотехнически простого запоминающего элемента, состоящего из транзистора и конденсатора. Поэтому проблема создания гигабитной полупроводниковой памяти